

高频等离子表面处理装置



■ 操作性・功能

- 射频 13.56Mhz 0-500W 高功率机型，发生器自动匹配，无需调节反射波，进一步增加的操作的便捷性。
- 标准配备数字式皮拉尼传感器，实时显示真空度，使得控制更为精确。
- 一体成型铝制腔体，腔体材质结实可靠而且无需担忧因为腔体材质的原因导致样品受到污染。

■ 安全性・保护

- 标准装备自我诊断功能，可实时监测和了解机器的运转状态。
- 装载有过电流漏电保护开关、自诊断回路、异常时蜂鸣器报警等安全功能。

内槽



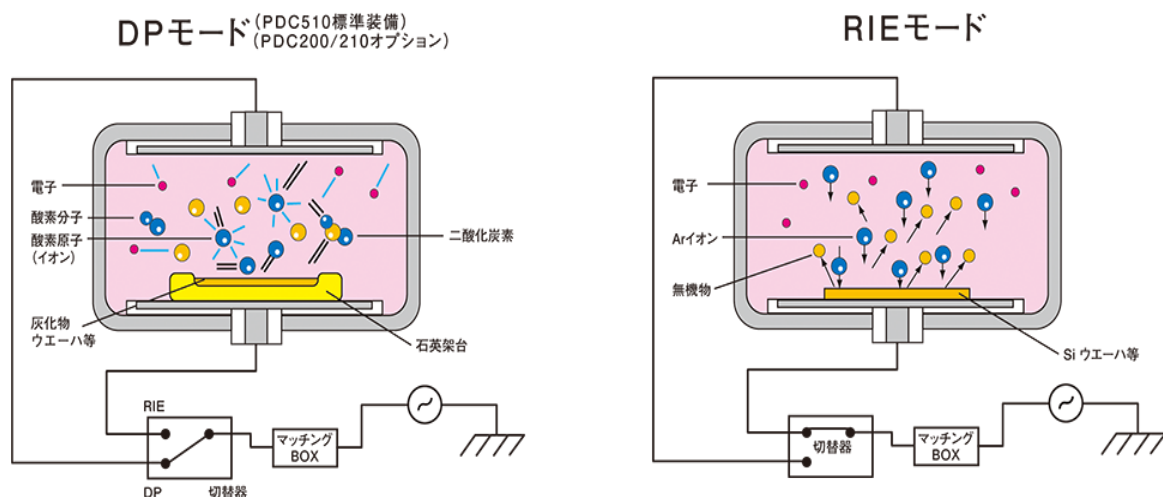
■ 产品优势

- DP和RIE模式标准配备即可利用等离子体的化学性质又可以有效利用其物理性质，工艺应用范围更加广泛。。
- 原则上所有材质的样品都可以进行清洗，对清洗样品材质没有要求。
- 液晶触摸屏控制，操作简单方便。
- 标准配备产生等离子均匀性很好的平行平板电极。
- 标准装备多种安全功能，安全措施绵密。

■ 用途

- CSP/BGA/COB 基板等离子清洗
- 去除有机膜和金属氧化膜
- 印刷电路基板的干式清洗
- 材料表面活化处理
- LDE 封装

■ 构成图



■ 技术规格

型号	PDC510	
方式	RIE 模式/DP 模式	
性能	发生器功率:	0-500W
	发生器频率:	射频 RF13.56Mhz
	发生器匹配方式:	自动匹配 (Auto matching)
构成	腔体材质:	一体成型铝制腔体
	腔体内尺寸:	W500×D300×H200mm
	电极尺寸:	W400×D200
	反应气体:	二路工艺气体, 可支持氧气、氩气、氮气等非腐蚀性气体
	控制显示方式:	液晶触摸屏、全自动控制
	真空度显示:	数字式皮拉尼传感器, 实时显示腔体内真空度。
	反应气体流量控制:	MFC 质量流量计
	门:	铰链门带观察窗
	外形尺寸:	W700×D700×H1285mm
	真空泵:	干式真空泵 NEODRY 36E (油泵可选)
	真空泵抽速:	36m ³ /h
	电源规格:	三相 200V 8A
	重量:	约 180kg